

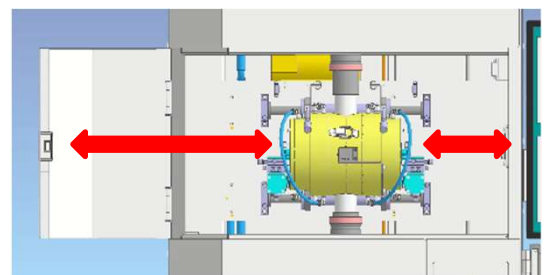
※開発中の画像です。実際の装置とは仕様異なる可能性があります。

システムアップ可能なスタンダードFZ炉 SC30

特徴

1. 大型ミラー搭載

集光率向上、高出力ランプの掲載、
大口徑試料チャンバーの搭載を実現。

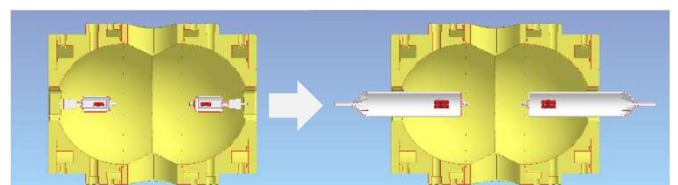


2. 広い作業スペース

試料棒のセッティング、ランプ位置の微調整、
育成完了後の結晶取り出しを容易に実施可能。

3. 豊富なオプション

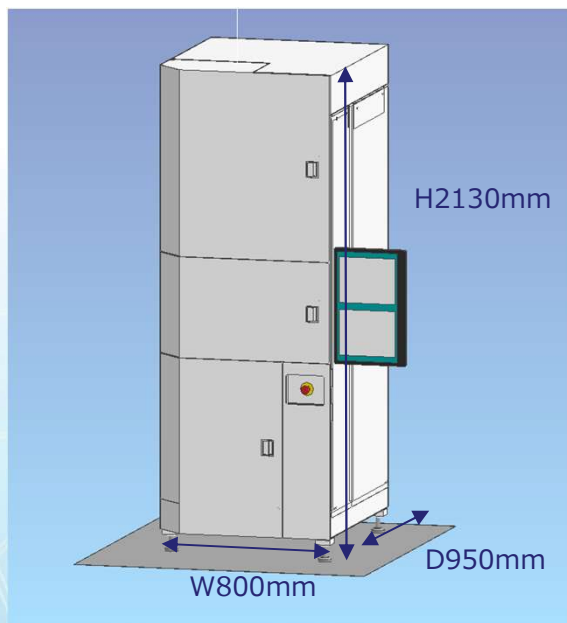
後付け出来るオプションにより、装置能力や
使い勝手が拡張可能。



仕様

		標準	オプション (別途費用追加)
反射鏡		双楯円反射鏡 Φ145mm	双楯円反射鏡 Φ120mm
チャンバー (石英管)		外形Φ50mm, 内径Φ40mmタイプ石英管	蒸発物トラップ、排気ポート、 外形Φ40mm, 内径Φ32mmタイプ石英管
育成可能長		150mm	-
加熱源	ランプ出力	650w×2pcs	1050w×2pcs / 1500w×2pcs
	ランプ電源	2kW×1 本体内蔵	2kW×2 本体内蔵(出力UPとセット)
主軸駆動	送り駆動方式	デジタル制御	-
	結晶育成速度	0.1~50.0mm/hr	-
	ギャップ調整/退避速度	1~300mm/min	-
	回転駆動方式	デジタル制御	-
	回転速度	5~60rpm	-
必要用カ	電気	Φ3,200V,40A	Φ3,200V,60A(1050Wランプ以上選択時)
	冷却水	外部供給 5~8L/min	内部循環(650Wランプ限定)
雰囲気ガス	ガス/最大加圧	汎用流体 (空気, Ar, N ₂)	酸素対応、最大950kPa
	特記	過圧保護付き、圧力/流量調整機器なし	圧力/流量調整機器、ガス供給2系統
カメラ画像		CMOS カメラ USB2.0 120M pixel	CMOS カメラ USB3.0 130M pixel ソフト機能拡張
ランプホルダー調整機構		ステージ+マイクロメータ	-
反射鏡開閉方式		左右スライド	-
操作方法		PC画面操作 (PC, モニタ装置内蔵)	モニタ別置、 操作ソフトのみ (顧客PCからリモート操作のみ)
レシピ機能		本体内蔵	-
設置先天井 必要高さ		2200mm	-

レイアウト



重量 1000kg

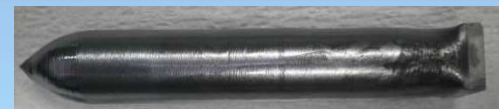
育成例



Ruby (Al₂O₃+Cr₂O₃)



Magnetite (Fe₃O₄)



Si (intrinsic)

※定価・仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせ先：キヤノンマシナリー株式会社 FAシステム事業本部 技術営業部
〒524-0044 滋賀県守山市古高町574(守山事業所)

Phone **077-581-2091** /
E-mail **cmi-sales-ml@mail.canon**

URL <https://machinery.canon/>



Machinery Movie